

ROZKŁAD ZAJĘĆ dla INŻYNIERSKICH STUDIÓW ZAOCZNYCH

ZJAZD I

| Godziny | 24 - 25 lutego 2018 r. | | | |
|-----------------------|--|--|--|---------------|
| | SOBOTA | | NIEDZIELA | |
| | Z30 (AR-N161) | Z34 (MT-N161) | Z30 (AR-N161) | Z34 (MT-N161) |
| 8 ¹⁵ - 9 | OPTOMECHATRONIKA wykład s. 422 (3/25) | | Język obcy ćw. s. 140, 206, 244, GG-426A (1/8) godz. 7 ³⁰ - 10 ³⁰ | |
| 9 ¹⁵ - 10 | | | | |
| 10 ¹⁵ - 11 | | | | |
| 11 ¹⁵ - 12 | ROBOTYKA wykład s. 422 (3/25) | | OPTOMECHATRONIKA wykład s. 422 (5/25) | |
| 12 ¹⁵ - 13 | | | | |
| 13 ¹⁵ - 14 | | | ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ wykład s. 422 (3/15) | |
| 14 ¹⁵ - 15 | STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (3/22) | NAPĘDY MECHATRONICZNE wykład s. 603 (3/12) | | |
| 15 ¹⁵ - 16 | | | | |
| 16 ¹⁵ - 17 | | | | |

ZJAZD II

| Godziny | 03 - 04 marca 2018 r. | | | |
|-----------------------|--|--|--|---------------|
| | SOBOTA | | NIEDZIELA | |
| | Z30 (AR-N161) | Z34 (MT-N161) | Z30 (AR-N161) | Z34 (MT-N161) |
| 8 ¹⁵ - 9 | ROBOTYKA wykład s. 422 (6/25) | | Język obcy ćw. s. 140, 206, 244, GG-426A (2/8) godz. 7 ³⁰ - 10 ³⁰ | |
| 9 ¹⁵ - 10 | | | | |
| 10 ¹⁵ - 11 | | | | |
| 11 ¹⁵ - 12 | OPTOMECHATRONIKA wykład s. 422 (8/25) | | OPTOMECHATRONIKA wykład s. 422 (10/25) | |
| 12 ¹⁵ - 13 | | | | |
| 13 ¹⁵ - 14 | | | ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ wykład s. 422 (6/15) | |
| 14 ¹⁵ - 15 | STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (6/22) | NAPĘDY MECHATRONICZNE wykład s. 603 (6/12) | | |
| 15 ¹⁵ - 16 | | | | |
| 16 ¹⁵ - 17 | | | | |

ZJAZD III

| Godziny | 10 - 11 marca 2018 r. | | | |
|-----------------------|--|---------------|--|---------------|
| | SOBOTA | | NIEDZIELA | |
| | Z30 (AR-N161) | Z34 (MT-N161) | Z30 (AR-N161) | Z34 (MT-N161) |
| 8 ¹⁵ - 9 | ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ wykład s. 422 (9/15) | | ROBOTYKA wykład s. 422 (12/25) | |
| 9 ¹⁵ - 10 | | | | |
| 10 ¹⁵ - 11 | | | | |
| 11 ¹⁵ - 12 | ROBOTYKA wykład s. 422 (9/25) | | ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ wykład s. 422 (12/15) | |
| 12 ¹⁵ - 13 | | | | |
| 13 ¹⁵ - 14 | | | | |
| 14 ¹⁵ - 15 | NAPĘDY MECHATRONICZNE wykład s. 603 (9/12) | | OPTOMECHATRONIKA wykład s. 422 (13/25) | |
| 15 ¹⁵ - 16 | | | | |
| 16 ¹⁵ - 17 | | | | |

ROZKŁAD ZAJĘĆ dla INŻYNIERSKICH STUDIÓW ZAOCZNYCH

ZJAZD IV

| Godziny | 17 - 18 marca 2018 r. | | | |
|-----------------------|--|---|---|---------------|
| | SOBOTA | | NIEDZIELA | |
| | Z30 (AR-N161) | Z34 (MT-N161) | Z30 (AR-N161) | Z34 (MT-N161) |
| 8 ¹⁵ - 9 | HES ćw. s. 422 (2/20) | | Język obcy ćw. s. 140, 206, 244, GG-426A (3/8) godz. 7 ³⁰ - 10 ³⁰ | |
| 9 ¹⁵ - 10 | | | | |
| 10 ¹⁵ - 11 | ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ wykład s. 422 (15/15) koniec | | Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (3/28) | |
| 11 ¹⁵ - 12 | | | | |
| 12 ¹⁵ - 13 | | | | |
| 13 ¹⁵ - 14 | STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (9/22) | NAPĘDY MECHATRONICZNE wykład s. 603 (12/12) koniec | Sterowanie procesów ciągłych ćwicz. s. 422 (3/12) | |
| 14 ¹⁵ - 15 | | | | |
| 15 ¹⁵ - 16 | | | Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (3/28) | |
| 16 ¹⁵ - 17 | | | | |

ZJAZD V

| Godziny | 24 - 25 marca 2018 r. | | | |
|-----------------------|---|---------------|--|---------------|
| | SOBOTA | | NIEDZIELA | |
| | Z30 (AR-N161) | Z34 (MT-N161) | Z30 (AR-N161) | Z34 (MT-N161) |
| 8 ¹⁵ - 9 | ROBOTYKA wykład s. 422 (15/25) | | ROBOTYKA wykład s. 422 (17/25) | |
| 9 ¹⁵ - 10 | | | | |
| 10 ¹⁵ - 11 | STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (11/22) | | Napędy mechatroniczne proj. s. 603 (4/10) | |
| 11 ¹⁵ - 12 | | | OPTOMECHATRONIKA wykład. s. 422 (18/25) | |
| 12 ¹⁵ - 13 | | | | |
| 13 ¹⁵ - 14 | OPTOMECHATRONIKA wykład. s. 422 (16/25) | | HES ćw. s. 422 (4/20) | |
| 14 ¹⁵ - 15 | | | | |
| 15 ¹⁵ - 16 | | | | |

ZJAZD VI

| Godziny | 07 - 08 kwietnia 2018 r. | | | |
|-----------------------|---|--|---|---------------|
| | SOBOTA | | NIEDZIELA | |
| | Z30 (AR-N161) | Z34 (MT-N161) | Z30 (AR-N161) | Z34 (MT-N161) |
| 8 ¹⁵ - 9 | OPTOMECHATRONIKA wykład. s. 422 (20/25) | | Język obcy ćw. s. 140, 206, 244, GG-426A (4/8) godz. 7 ³⁰ - 10 ³⁰ | |
| 9 ¹⁵ - 10 | | | | |
| 10 ¹⁵ - 11 | Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (6/28) | Podstawy automatyki - II lab. s. (3/25) | STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (15/22) | |
| 11 ¹⁵ - 12 | | | | |
| 12 ¹⁵ - 13 | Podstawy automatyki - II lab. s. (3/25) | | Napędy mechatroniczne proj. s. 603 (6/10) | |
| 13 ¹⁵ - 14 | | | | |
| 14 ¹⁵ - 15 | | | | |
| 15 ¹⁵ - 16 | | | Sterowanie procesów ciągłych ćwicz. s. 422 (6/12) | |
| | | | Napędy mechatroniczne lab. s. 603 (6/12) | |

ROZKŁAD ZAJĘĆ dla INŻYNIERSKICH STUDIÓW ZAOCZNYCH

ZJAZD VII

| Godziny | 14 - 15 kwietnia 2018 r. | | | |
|-----------------------|---|---|--|------------------------------------|
| | SOBOTA | | NIEDZIELA | |
| | Z30 (AR-N161) | Z34 (MT-N161) | Z30 (AR-N161) | Z34 (MT-N161) |
| 8 ¹⁵ - 9 | OPTOMECHATRONIKA wykład. s. 422 (23/25) | | ROBOTYKA wykład s. 422 (23/25) | |
| 9 ¹⁵ - 10 | | | | |
| 10 ¹⁵ - 11 | | | | |
| 11 ¹⁵ - 12 | Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (9/28) | Podstawy automatyki - II lab. s. (6/25) | HES ćw. s. 422 (6/20) | |
| 12 ¹⁵ - 13 | | | Zarządzanie jakością lab. s. (2/10) | Optomechatronika lab. s. (2/12) |
| 13 ¹⁵ - 14 | | | | |
| 14 ¹⁵ - 15 | Podstawy automatyki - II lab. s. (6/25) | Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (9/28) | Optomechatronika lab. s. (2/12) | |
| 15 ¹⁵ - 16 | | | Zarządzanie jakością lab. s. (2/10) | |
| 16 ¹⁵ - 17 | | | | |

ZJAZD VIII

| Godziny | 21 - 22 kwietnia 2018 r. | | | |
|-----------------------|--|--|---|---------------|
| | SOBOTA | | NIEDZIELA | |
| | Z30 (AR-N161) | Z34 (MT-N161) | Z30 (AR-N161) | Z34 (MT-N161) |
| 8 ¹⁵ - 9 | HES ćw. s. 422 (8/20) | | Język obcy ćw. s. 140, 206, 244, GG-426A (5/8) godz. 7 ³⁰ - 10 ³⁰ | |
| 9 ¹⁵ - 10 | | | | |
| 10 ¹⁵ - 11 | | | | |
| 11 ¹⁵ - 12 | Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (12/28) | Podstawy automatyki - II lab. s. (9/25) | STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (17/22) | |
| 12 ¹⁵ - 13 | | | Napędy mechatroniczne proj. s. 603 (8/10) | |
| 13 ¹⁵ - 14 | | | | |
| 14 ¹⁵ - 15 | Podstawy automatyki - II lab. s. (9/25) | Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (12/28) | Sterowanie procesów ciągłych ćwicz. s. 422 (9/12) | |
| 15 ¹⁵ - 16 | | | Napędy mechatroniczne lab. s. 603 (9/12) | |

ZJAZD IX

| Godziny | 28 - 29 kwietnia 2018 r. | | | |
|-----------------------|--|--|---|------------------------------------|
| | SOBOTA | | NIEDZIELA | |
| | Z30 (AR-N161) | Z34 (MT-N161) | Z30 (AR-N161) | Z34 (MT-N161) |
| 8 ¹⁵ - 9 | ROBOTYKA wykład s. 422 (25/25) koniec | | HES ćw. s. 422 (10/20) | |
| 9 ¹⁵ - 10 | | | | |
| 10 ¹⁵ - 11 | Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (15/28) | Podstawy automatyki - II lab. s. (12/25) | OPTOMECHATRONIKA wykład. s. 422 (25/25) koniec | |
| 11 ¹⁵ - 12 | | | Zarządzanie jakością lab. s. (4/10) | Optomechatronika lab. s. (4/12) |
| 12 ¹⁵ - 13 | | | | |
| 13 ¹⁵ - 14 | Podstawy automatyki - II lab. s. (12/25) | Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (15/28) | Optomechatronika lab. s. (4/12) | |
| 14 ¹⁵ - 15 | | | Zarządzanie jakością lab. s. (4/10) | |
| 15 ¹⁵ - 16 | | | | |

ROZKŁAD ZAJĘĆ dla INŻYNIERSKICH STUDIÓW ZAOCZNYCH

ZJAZD X

| Godziny | 12 - 13 maja 2018 r. | | | |
|-----------------------|--|--|---|--|
| | SOBOTA | | NIEDZIELA | |
| | Z30 (AR-N161) | Z34 (MT-N161) | Z30 (AR-N161) | Z34 (MT-N161) |
| 8 ¹⁵ - 9 | HES ćw. s. 422 (12/20) | | Język obcy ćw. s. 140, 206, 244, GG-426A (6/8) godz. 7 ³⁰ - 10 ³⁰ | |
| 9 ¹⁵ - 10 | | | | |
| 10 ¹⁵ - 11 | Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (18/28) | Podstawy automatyki - II lab. s. (15/25) | Zarządzanie jakością lab. s. (6/10) | Optomechatronika lab. s. (6/12) |
| 11 ¹⁵ - 12 | | | | |
| 12 ¹⁵ - 13 | | | | |
| 13 ¹⁵ - 14 | Podstawy automatyki - II lab. s. (15/25) | Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (18/28) | Optomechatronika lab. s. (6/12) | Zarządzanie jakością lab. s. (6/10) |
| 14 ¹⁵ - 15 | | | | |
| 15 ¹⁵ - 16 | | | | |
| 16 ¹⁵ - 17 | | | HES ćw. s. 422 (14/20) | |

ZJAZD XI

| Godziny | 19 maja 2018 r. | | | |
|-----------------------|--|--|---------------|---------------|
| | SOBOTA | | NIEDZIELA | |
| | Z30 (AR-N161) | Z34 (MT-N161) | Z30 (AR-N161) | Z34 (MT-N161) |
| 8 ¹⁵ - 9 | STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (19/22) | Napędy mechatroniczne proj. s. 603 (10/10) koniec | | |
| 9 ¹⁵ - 10 | | | | |
| 10 ¹⁵ - 11 | Sterowanie procesów ciągłych ćwicz. s. 422 (12/12) koniec | Napędy mechatroniczne lab. s. 603 (12/12) koniec | | |
| 11 ¹⁵ - 12 | | | | |
| 12 ¹⁵ - 13 | | | | |
| 13 ¹⁵ - 14 | Zarządzanie jakością lab. s. (8/10) | Optomechatronika lab. s. (8/12) | | |
| 14 ¹⁵ - 15 | | | | |
| 15 ¹⁵ - 16 | Optomechatronika lab. s. (8/12) | Zarządzanie jakością lab. s. (8/10) | | |
| 16 ¹⁵ - 17 | | | | |

ZJAZD XII

| Godziny | 26 - 27 maja 2018 r. | | | |
|-----------------------|--|--|---|--|
| | SOBOTA | | NIEDZIELA | |
| | Z30 (AR-N161) | Z34 (MT-N161) | Z30 (AR-N161) | Z34 (MT-N161) |
| 8 ¹⁵ - 9 | HES ćw. s. 422 (16/20) | | Język obcy ćw. s. 140, 206, 244, GG-426A (7/8) godz. 7 ³⁰ - 10 ³⁰ | |
| 9 ¹⁵ - 10 | | | | |
| 10 ¹⁵ - 11 | Podstawy automatyki - II lab. s. (18/25) | Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (21/28) | Zarządzanie jakością lab. s. (10/10) koniec | Optomechatronika lab. s. (10/12) |
| 11 ¹⁵ - 12 | | | | |
| 12 ¹⁵ - 13 | | | | |
| 13 ¹⁵ - 14 | Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (21/28) | Podstawy automatyki - II lab. s. (19/25) | Optomechatronika lab. s. (10/12) | Zarządzanie jakością lab. s. (10/10) koniec |
| 14 ¹⁵ - 15 | | | | |
| 15 ¹⁵ - 16 | | | | |
| 16 ¹⁵ - 17 | | | | |

ROZKŁAD ZAJĘĆ dla INŻYNIERSKICH STUDIÓW ZAOCZNYCH

ZJAZD XIII

| Godziny | 02 - 03 czerwca 2018 r. | | | |
|-----------------------|---|---|---|---------------|
| | SOBOTA | | NIEDZIELA | |
| | Z30 (AR-N161) | Z34 (MT-N161) | Z30 (AR-N161) | Z34 (MT-N161) |
| 8 ¹⁵ - 9 | HES ćw. s. 422 (18/20) | | STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (22/22) koniec | |
| 9 ¹⁵ - 10 | | | | |
| 10 ¹⁵ - 11 | Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (24/28) | Podstawy automatyki - II lab. s. (22/25) | | |
| 11 ¹⁵ - 12 | | | | |
| 12 ¹⁵ - 13 | | | | |
| 13 ¹⁵ - 14 | Podstawy automatyki - II lab. s. (22/25) | Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (24/28) | | |
| 14 ¹⁵ - 15 | | | | |
| 15 ¹⁵ - 16 | | | | |
| 16 ¹⁵ - 17 | | | | |

ZJAZD XIV

| Godziny | 09 - 10 czerwca 2018 r. | | | |
|-----------------------|---|---|---|--|
| | SOBOTA | | NIEDZIELA | |
| | Z30 (AR-N161) | Z34 (MT-N161) | Z30 (AR-N161) | Z34 (MT-N161) |
| 8 ¹⁵ - 9 | HES ćw. s. 422 (20/20) koniec | | Język obcy ćw. s. 140, 206, 244, GG-426A (8/8) godz. 7 ³⁰ - 10 ³⁰ | |
| 9 ¹⁵ - 10 | | | | |
| 10 ¹⁵ - 11 | Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (27/28) | Podstawy automatyki - II lab. s. (25/25) koniec | Optomechatronika lab. s. (12/12) koniec | |
| 11 ¹⁵ - 12 | | | | Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (28/28) koniec |
| 12 ¹⁵ - 13 | | | | |
| 13 ¹⁵ - 14 | Podstawy automatyki - II lab. s. (25/25) koniec | Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (27/28) | Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (28/28) koniec | Optomechatronika lab. s. (12/12) koniec |
| 14 ¹⁵ - 15 | | | | |
| 16 ¹⁵ - 17 | | | | |

SESJA LETNIA:

I – termin: 16-17 czerwca 2018 r.

II – termin: 23-24 czerwca 2018 r.

16 czerwca 2018 r. egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2

SESJA JESIENNA:

I – termin: 08-09 września 2018 r.

II – termin: 15-16 września 2018 r.